O impacto da amostragem nas medidas morfológicas não paramétricas Leonardo Ferreira¹, Fabricio Ferrari¹

1- Instituto de Matemática Estatística e Física - Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS, Brazil

Introdução

Um passo importante para entender como as galáxias se formam e evoluem é ser capaz de medir as suas propriedades em diversos redshifts. As medidas morfométricas não paramétricas permitem que meçamos algumas dessas características sem nos preocuparmos com a forma da galáxia, facilitando a redução de dados fotométricos de grandes surveys disponíveis atualmente e servindo de ferramenta para classificação automática. Mesmo assim, devemos tomar cuidado pois tais parâmetros podem sofrer influência da amostragem da imagem, da PSF e do ruído, principalmente em regimes de redshift alto, onde esses efeitos são mais pronunciados em relação às imagens de galáxias no universo local. A fim de entender o impacto da amostragem em tais parâmetros, reamostramos o catálogo EFIGI para diversas resoluções e então efetuamos as medidas novamente utilizando o pacote Morfometryka, verificando como as distribuições delas mudam com a resolução, destacando quais parâmetros se mostram mais robustos para efetuar medidas em imagens com resoluções baixas.

Medidas não paramétricas vs. Amostragem

A Figura 3 mostra a comparação das distribuições em cada passo da amostragem para as medidas não paramétricas citadas anteriormente.



Catálogo EFIGI e reamostragem

O catalogo EFIGI (Baillard et al. 2011) conta com imagens em 5 bandas (u,g,r,i,z) de 4458 galáxias do universo local com informações de redshift e uma detalhada descrição morfológica, descrevendo o diagrama de Hubble em sua totalidade. A Figura 1 mostra a distribuição dos tipos morfológicos do catálogo. Ele se faz útil por fornecer uma amostra bem definida para efetuarmos a comparação após a reamostragem e simulações de redshift. No caso deste trabalho, reamostramos todas imagens do catálogo para diversas resoluções utilizando interpolação de *Splines* para as resoluções de 1024, 768, 512, 384, 256, 128 e 64 pixels².

 $\begin{array}{c} 600 \\ 500 \\ 0.08 \\ 500 \\ 0.08 \\ 500 \\ 0.08 \\ 500 \\ 0.08 \\ 500 \\ 0.08 \\ 500 \\ 0.08 \\ 500 \\ 0.08 \\ 500 \\ 0.08 \\ 500 \\ 0.08 \\ 500 \\ 0.08 \\ 0.008$

Figure: Distribuição dos tipos morfológicos do catálogo EFIGI. Adaptado de Barden et al. 2011.

Morfometryka e as medidas não paramétricas

O pacote Morfometryka (Ferrari et al. 2015, Figura 2) foi utilizado para efetuar as medidas não paramétricas dos catálogos reamostrados. Ele recebe como parâmetro a imagem da galáxia junto de sua PSF, subtrai o céu, encontra o objeto, mede o centro, o tamanho dos eixos e o ângulo de posição; efetua fotometria de abertura, ajustando um perfil de Sérsic e efetua as medidas não paramétricas de Concentração (C_1 , C_2), Assimetria (A_1), Suavidade (S_1), Coeficiente de Gini (G), Momento de Segunda Ordem de 20% dos pixeis mais brilhantes (M_{20}) e a Entropia de Shannon (H) (Conselice 2014 para uma revisão). O Morfometryka introduz também novos índices de Assimetria (A_3) e Suavidade (S_3) baseados no coeficiente de correlação de postos de Spearman.









Conclusões

- ► Os índices A₃ e S₃ são mais estáveis que os índices tradicionais A₁ e S₁ com relação à resolução.
- ► O coeficiente de Gini é **extremamente estável**.
- Os índices de Concentração tendem a convergir para os valores da PSF em resoluções muito baixas.
- Esses resultados mostram que a amostragem é crucial para as medidas morfométricas.

Referências

- Conselice C. J., 2014, ARAA, 52, 291
- Baillard A., et al., 2011, AA, 532, A74
- F. Ferrari et al. Morfometryka A New Way of Establishing Morphological Classification of Galaxies,
 2015, in preparation. www.ferrari.pro.br



Figure: Cada painel mostra uma medida não paramétrica em função da resolução da imagem, sendo que a resolução diminui da esquerda para direita. A distribuição em forma de violino é análoga a uma distribuição de caixa: o ponto branco em cada distribuição mostra a mediana, a linha grossa no centro corresponde ao intervalo entre o quartil inferior e o quartil superior e a linha fina corresponde aos limites inferiores e superiores.

Agradecimentos

Universidade Federal do Rio Grande - FURG Valérie de Lapparent por ceder generosamente as imagens originais do EFIGI - IAP-Paris.

http://www.ferrari.pro.br/

leonardo.ferreira.furg@gmail.com, fabricio@ferrari.pro.br